

気体流量10ミリ秒で切り替え

東大が高速バルブ制御技術

東京大学の服部光希大学院生と大西昌准教授らは、気体流量を10ミ秒で切り替える高速バルブ制御技術を開発した。制御信号を送つてから流量が目標値に到達するまでの応答時間を98%削減できる。空気は伝搬が遅いため流路を切り替えると振動が発生してしまう。振動を抑えつつ急速に切り替えることが難しかった。ガスを精密に供給する半導体製造装置や空圧機器などに提案していく。

流路を開閉する弁体
の位置を計測できる圧
縮性相殺バルブで空氣
振動などのモデルを作

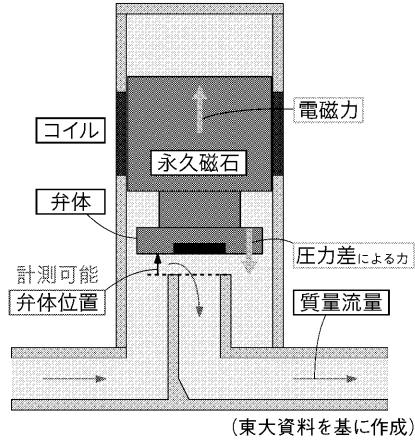
り制御に反映した。バ
ルブの中で弁体を上下

振動を抑え、急速に切り替えることが難しかった。一方で供給する半導体製造装置や空圧機器などに提案していく。

てから流量が目標値に到達するまでの応答時間を90%消滅できる。空氣は伝搬が遅いため流路を切り替えると振動が発生してしまう。

東京大学の服部光希大学院生と大西昌准教授らは、気体流量を10ミ秒で切り替える高速バルブ制御技術を開発した。制御信号を送つ

圧縮性相殺バルブの仕組み



(東大資料を基に作成)

ようにした。

な流れが生じる。これを精密にモデル化するのはコストが大きいため、弁体の位置に応じて流量のデータを事前に取り参照処理できる

機器を利用する可能性がある。

ノイズの定常変化と減衰振動、気体の粘性摩擦などを元にバルブへの入力値を計算して制御する。カスケード制御と組み合わせて検証すると、応答時間が

45.8秒から10.5秒に短縮した。バルブを開くという信号を入力してから10.5秒で目標流量に到達する。振動も抑えられた。

半導体成膜装置ではガスの供給量を精密に制御でき、積層する原子層の厚みや間隔などを調整できるようになる。エアシリンダーなどの空圧機器では、制御性能が水や油などの液体積変化の小さな流体機器に近づく。高速応答が必要で電動のアクチュエーターを用いていた箇所に安価な空圧機器を適用できる可能性がある。